低エネルギーパルスによる

2光子誘起屈折率回折格子の書き込み

西岡研究室 早坂 圭介 (0112102)

1. 序論

当研究室では2光子ゲート法を用いたパルス波 形の記録と再生を行っている(図1)。光強度の2 乗に比例して起きる2光子吸収によって屈折率が 変化する材料を用いて、パルスの周波数情報を格子 間隔として記録する。記録した回折格子を用いると パルスの時間反転再生を行うことができる。書き込 み材料として色ガラスを用いた研究は既に成功し ているが、書き込みに必要なパルスエネルギーが数 mJで増幅システムを用いる必要があり、装置の小 型化・低エネルギー化の障害になっている。そこで、 この研究では発振器単独で2光子吸収により屈折 率変化がおきる材料を開発することを目的とし、 mJからnJへの6桁の低エネルギー化を目指した。



図1 2光子ゲート法を用いたパルス波形の記録 と時間反転再生の様子。

2. 超短パルス・微小領域書き込み光学系

この研究では高い光強度と時間分解能を得るためにサブ10fsのモード同期レーザーを用いた。図2がそのパルス幅とスペクトルである。

10 fs のパルスの空間的な長さはわずか 3 µm で その中にレーザーの中心波長である 800 nm の光は わずか 4 サイクルしか存在できない。そのため、こ のパルスの干渉により屈折率回折格子を書き込ん だ場合、書き込まれる回折格子の周期数もまたわず か4本である。 また、このような超短パルス光を発生させるには 半値全幅にして 146 nm に及ぶ広帯域なスペクトル の光が必要になる。そのため、10 fs のパルスの記 録と再生を行う際はこの点に注意する必要がある。



図2 モード同期レーザーのスペクトル(左)と モード同期レーザーのパルス幅(右)。

図3が書き込みに用いた装置図である。

この実験では光源から試料まで4mあるので、 ビームが持つ初期の広がり角が無視できない。そこ でコリメーションミラーを用いてビームの広がり 角を軽減している。

サブµm オーダーの高安定な干渉計を組み、2つ のパルスの時間合わせを行い、ビームスプリッター 上にできる干渉縞を2つのレンズを用いて試料中 に縮小投影する。また、この2つのレンズの群遅延 分散を補償するためにチャープ鏡対を使用した。



図3 書き込み装置図(CM:Collimation Mirror, AP:Aperture, BS:Beam Splitter, CC:Corner Cube)。

この実験では書き込み時の光強度を上げるため に、図4のような縮小投影を行った。縮小倍率は2 つのレンズの焦点距離で決まる。干渉像を1/44 倍 にして縮小投影することにより、書き込み時の光強 度をビームスプリッター上の光強度の2000 倍にし ている。



図4 干渉像の 1/44 倍 縮小投影

このような高倍率な縮小投影を行うと0次光の 集光位置と干渉縞ができる位置が接近すると考え られる。

屈折率変化は光強度の2乗に比例して起きる。干 渉縞の明の部分より0次光の集光位置の光強度の 方が高いので、離れていないと試料中には干渉縞で なく2つのスポットが書き込まれることになる。

そこでこの位置関係を計算したのが図5である。 0次光の集光位置と干渉縞ができる位置は1015 μm離れていて、Confocal 長は1128 μm であるこ とから、この実験では十分離れているといえる。

この縮小投影を用いると、試料中に図 5 のような 干渉縞ができる。試料中にできる干渉縞は幅 13 μm、 厚さ 207 μm、格子間隔 3.363 μm、F 値は 6.4 であ る。また、書き込み時の光強度は 3.73 GW/cm² で ある。



図5 試料中にできる干渉縞の様子。

縮小投影に用いる2つのレンズは図6のような 群遅延分散を持っていて、800 nm においては合計 1261 fs²である。これにより10 fsのパルスは130 fs にまで広がってしまう。



図6 2つのレンズの群遅延分散

そこで図7のような負分散を持つチャープ鏡上 で22回反射させ合計で-1320 fs²の分散を与えて、 2つのレンズの群遅延分散補償を行った。



3. 2光子記録材料

低エネルギーパルスで屈折率変化が起きる材料 として我々が注目した材料は吸収断面積が10⁻¹⁶ cm²オーダーの色素である。

2 光子吸収波長の 400 nm で大きな吸収を持ち、 基本波の 800 nm でまったく吸収のない色素を検索 した。その結果、Coumarin102 と Coumarin307 が 適合した。図 8 がその吸収スペクトルである。2 光 子吸収波長において大きな吸収を持つことが分か る。



色素は酢酸ビニル樹脂に溶かし、石英板上で薄膜 にして、書き込み材料として使用する。用いた色素 と膜厚の異なる3つの試料を作成し(表1)、実験

使用した有機色素	色素膜の厚さ	光学密度	
	(nm)	(400 nm)	
Coumarin307	26	4	
Coumarin102	30	5	
Coumarin307	72	11	

耒 1	作成し	た書きい	み試髪
18 1		LECV	ヽロアnルホイ

3. 広帯域な回折

を行った。

図9の装置を用いて回折波のスペクトルと書き 込み光のスペクトル(Reference)を測定した。測 定に当たっては書き込み光の1つをシャッターで 遮り、再生された回折波をNDフィルターとディフ ューザーを用いて減衰し、分光器に取り込む。図9 の波線部分には図3の光源・干渉計・チャープ鏡対 が省略されている。





この装置を用いて測定した結果が図10である。 書き込み時間を変えて測定を行っている。ただし、 Referenceは波形比較のため測定値の1/200にして いる。図10より書き込み時間とともに回折波の長 波長側のスペクトル帯域が広がっていくことが分 かる。これは、色素の長波長側の吸収が小さいため、 観測可能な光強度の回折波が起きるだけの屈折率 変化を得るのに時間がかかるためであると考えら れる。また、書き込まれた回折格子から広帯域な回 折が起きていることが分かる。



4. 残留1光子吸収がないことの確認

この研究は2光子吸収による屈折率回折格子の 書き込みが目的なので1光子吸収が起きてはいけ ない。1光子吸収はCW光の光強度でも起きるの で、試料に基本波の吸収があれば屈折率回折格子が 書かれると予想できる。そこでまず残留1光子吸収 がないことを確認するためにモードロックを落と し、CW光で回折格子の書き込みを行った。その結 果、回折効率が0なので、残留1光子吸収がないこ とを確認できた。

次に、モードロックをかけてパルスにした状態で 回折格子の書き込みを行った。その結果、回折効率 が書き込み時間とともに上昇したので、2光子吸収 による書き込みが行えたことが分かる。





5. 回折効率の時間変化

書き込み時間を変えて回折効率を測定したのが 図12である。回折効率は書き込み時間が10分に 達するまでは時間とともに上昇し、それ以降減少す ることが分かった。ピーク時の回折効率は0.31% である。

この回折効率の減少の原因は2つ考えられる。1 つは機械振動や空気の擾乱によるビームの集光位 置のずれや入射角の変化により、試料中にできる干 渉縞の位置や格子間隔が変わってしまうことであ る。もう1つは熱拡散により、干渉縞の暗の部分の 屈折率も変わってしまうことである。



図 1 2 回折効率の書き込み时间に対する変化 (Coumarin307,72 μm)。

6. 回折効率と屈折率変化

測定した回折効率より屈折率変化を求める。その ために書き込まれた回折格子を光学長λ/4 で屈折率 の高い層と低い層が交互に積層された多層膜であ るとして、その反射率を求めることにより屈折率変 化を求めた。



まず、屈折率の異なる境界面での光電界の反射係 数口は式1で表せる。

ただし、n₀は試料の線形屈折率、Δn は 2 光子吸 収によって誘起される屈折率変化である。

4 サイクルの光が干渉すると、光強度は8 サイク ルになる。屈折率回折格子は光強度で書き込まれる ので境界面は16枚できる。さらに反射係数Γは十 分小さいので、多層膜の光強度の反射率 R は式2 で表せる。

ただし、ηは測定した回折効率である。

この式にη=0.31 % 、n₀=1.5 を代入すると、 ∆n=0.01 である。

7. まとめ

6.3 nJ のパルスで2光子吸収による屈折率回折 格子の書き込みができ、4 周期で0.31 %の回折効 率が得られた。屈折率変化にして∆n=0.01 に相当す る。

参考文献

- [1] M. C. Nielsen, X. Shi and B. Lawrence, Proc. of. Leos, WEE2(2004).
- [2] H. Nishioka and K. Ueda. "Femtosecond pulse encoding and self phase-reconstruction by Time-Orderd Recording/Readout in Periodic Diffractive Optics (TORPEDO)", (2004).
- [3] 顕微鏡ユニットガイド 装置組み込みに最適な UIS 光学系顕微鏡ユニット (OLYMPUS 2003).
- [4] U. Brachmann, Lambdachrome Laser Dyes 3rd Edition, LAMBDA PHYSIK (2000).
- [5] Pochi Yeh, Introduction to Photorefractive nonlinear Optics (John Wiley & Sons, Inc., 1993).
- [6] Sigman, Lasers (University Science Books, 1981).
- [7] L. Hesselink. S. S. Orlov and M. C. Bashaw, Proc. Of. IEEE. 92, 1231(2004).
- [8] A. Stingl, M. Lenzner, Ch. Spielmann, F. Krausz and R. Szipocs, Opt. Lett. **20**, 602(1995).
- [9] A. Stingl, Ch. Spielmann, F Krausz and R. Szipocs, Opt. Lett. 19, 204(1994).